

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

МАГНА ТМ 22

Назначение: Нанесение многокомпонентных и многослойных металлических или диэлектрических тонких пленок на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.



Особенности:

- Групповая обработка подложек: 60x48, $\varnothing 76$ мм или $\varnothing 100$ мм;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Планетарный двухступенной подложкодержатель;
- Предварительный нагрев подложек и их очистка с помощью источника ионов в шлюзовой камере;
- Нанесение пленок в рабочей камере одним, двумя, тремя, четырьмя магнетронами;
- Безмасляная система откачки;
- Мощность потребления не более 20 кВт;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

